

Винахід належить до оптичного приладобудування. Спосіб виготовлення інтерференційного фільтра включає нанесення у вакуумі на підкладки інтерференційних шарів, що чергуються, із сульфиду цинку та фториду металу. Згідно з винаходом, як фторид металу використовують фторид ітрію, а виготовлені дві підкладки з різним числом шарів нанесеного інтерференційного покриття закріплюють за допомогою клею та герметика у металевій оправці, що має нижнє та верхнє посадочні гнізда для підкладок. Винахід забезпечує підвищення стійкості інтерференційного фільтра до динамічних навантажень під час прискорень руху фільтра при збереженні потрібних оптичних характеристик фільтра.